



# 光設計研究グループ 第70回研究会 「光加工の最新動向」



【日 時】2021年8月27日(金) 13:00-17:00

【場 所】オンライン (Zoom)

【ご案内】レーザーの発明以降、光の応用の一つとして、材料加工が発展してきました。光加工は、光除去加工、光溶接加工、リソグラフィなど多岐にわたり、それぞれの加工方法で製造業の発展を支えてきました。本研究会では、レーザー加工、マスクレス露光機、積層造形を題材に光加工の最新動向を講演いただく予定です。講演形式はZoomによるオンライン開催です。ぜひご参加ください。

## プログラム

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ・(仮) レーザー加工とサイバーフィジカルシステム | 小林洋平(東京大学)   |
| ・深層学習による補償光学を用いたレーザー加工    | 長谷川智士(宇都宮大学) |
| ・DUV 光マスクレス露光機の開発         | 渡邊 陽司(ニコン)   |
| ・金属レーザー積層造形の先端技術          | 京極秀樹(近畿大学)   |

【主 催】一般社団法人 日本光学会 光設計研究グループ 代表：長谷川 雅宣 (キヤノン)

【共 催】※本研究会の共催団体の一覧はホームページをご確認ください

【参加費】光設計研究グループ個人会員：3,000 円、光設計研究グループ学生会員：無料、

日本光学会会員：6,000 円、

光設計研究グループ賛助会員企業：6,000 円、一般：8,000 円

日本光学会学生会員：1,000 円、学生一般：1,000 円

※区分間違えの場合の返金は致しかねますので、十分ご確認の上お振込みください。

【聴講及び予稿ダウンロード】

参加申込者には、銀行振込後、閲覧用の ID とパスワードを発行します。

予稿のダウンロードは、研究会当日の9時より可能です。

希望に応じて、研究会後に予稿集(機関紙)を郵送いたします。

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

【申し込み方法】下記内容を E-mail 本文に記載し [k70reg@opticsdesign.gr.jp](mailto:k70reg@opticsdesign.gr.jp) までお送りください

お申込み後、お支払い方法をメールにて送付いたします。

お支払い確認後、閲覧用の ID、パスワードが発行される予定です。

三菱ケミカル(株) 入江 菊枝

※定員に余裕がある場合は会場にて当日受付致します

氏名(フリガナ)	
所 属	
住 所	〒
TEL、E-mail	
参加区分	1.光設計研究グループ個人会員 2.光設計研究グループ学生会員 3.光設計研究グループ賛助会員企業、日本光学会会員 4.日本光学会学生会員 5.一般 6.学生一般
事後に予稿集郵送	1.希望する 2.希望しない

※ 頂いた個人情報は、当研究会運営に必要な目的の範囲内においてのみ取扱います。

【問合せ先】(株)ニコン 光学本部 榎田 歩 E-mail: [k70@opticsdesign.gr.jp](mailto:k70@opticsdesign.gr.jp)